Gruppo di Microscopia a Sonda & Gruppo di Nanodeposizione con atomi freddi

- A Dipartimento di Fisica, Edificio B, Laboratori INFM
- A UNI
 M. Allegrini, E. Arimondo, F. Fuso, L. Pardi
 E. Andreoni, N. Puccini
 polyLab
 post-doc
 A. Camposeo
 Dottorandi
 Laureando
 D. Morganti

PISA 27 Gen. 2005

A Collaborazioni SPM

- . IPCF-CNR Sezione di Messina
- . Università di Messina
- . Politecnico Milano
- . University College London (Seminario Galileiano 18/2/2005 prof. Franco Cacialli)
-

A Collaborazioni ND

- Institut für Angewandte Physik, University of Bonn
- University of Toulouse
- University Clermont-Ferrand
- IMA, University of Kassel
- IPCF-CNR, Sezioni Pisa & Messina
- Dip. Scienza dei Materiali, Università Milano-Bicocca



STM Atomic resolution on High Oriented Pyrolitic Graphite (HOPG)



 10×10 nm





2D FFT ↓ Hexagonal symmetry

Single Cs Atoms on HOPG



AFM

Esempio: verifica a scala nanometrica di previsioni teoriche sull'attrito gomma-asfalto



Unità U3, Trieste

SNOM [esempio di nanolitografia ottica]

hh vantaggi delle tecniche di caratterizzazione ottica

I difficoltà a confinare l'energia e.m. in volumi sufficientemente piccoli per la caratterizzazione e modificazione a scala nanometrica

Limiti dell'ottica classica: "diffraction limit" La luce non può essere confinata su dimensioni lineari molto più piccole di _/2. (Abbe 1873)

Per il principio di indeterminazione di Heisenberg la posizione (Δx) e il momento ($p_x = hk_x/2\pi$) di un fotone sono legati da In un mezzo con indice di rifrazione n_i

 $k_{i}^{2} = k_{x}^{2} + k_{y}^{2} + k_{z}^{2}$ $|k|_{i} = 2\pi/_{i} = n_{i} |k|_{0}$

 $_{i}$ lunghezza d'onda nel mezzo, k_{0} vettore d'onda nel vuoto. *Far-field optics (ottica classica)* usa *solo* fotoni propaganti,

con componenti tutte reali di k e nessuna può essere > k_i C

l'incertezza della posizione Δx_{class} di un fotone in un fascio di luce libero di propagarsi (detta anche "*minima sezione d'urto*") è

 $\Delta x_{\text{class}} > 1/|k_x| = \frac{1}{2\pi}$

Per un obiettivo focalizzante la minima distanza risolvibile, detta "*dimensione critica*" nelle applicazioni di litografia, è

CD = α <u>NA</u> con α fattore dipendente dalla distribuzione di intensità del fascio di luce che illumina l'obiettivo e NA</u>

SNOM topography images of the optically nanostructured PMA4 thin film

- homopolymer (exposure time = 1 s/dot, image size = 5 x 5 μ m²)
- 30/70 copolymer (speed = 50 nm/s, size = 300 x 300 nm²)



[S. Patanè, A. Arena, M. Allegrini, L. Andreozzi, M. Faetti, and M. Giordano, Opt. Commun. 210, 37 (2002)]

PHOTOINDUCED BIREFRINGENCE



V.Likodimos, M.Labardi, L.Pardi, M.Allegrini, M.Giordano, A.Arena, S.Patanè, APL 82, 3313 (2003)

Goals

- Potential data densities for this technique? 1 Tbit/cm²
- How fast can data be written and read? 100 ns
- Resolution limits? Material: 3 nm cooperativity size 10 nm entanglement length

SNOM Tecnique: aperture size

- Film stability? Long term, with restrictions
- How soon will practical applications be possible? 2 to 5 years or 10 to 20 years?